

レーザー協会 第 203 回研究会

「ナノ・マイクロ領域の先端レーザー加工」

開催日時：令和7年9月24日(水)13:30～17:00

オンライン／対面 ハイブリッド

対面会場：東京科学大学大岡山キャンパス 本館 M123号室

研究会主旨：ナノ・マイクロ領域での先進的な加工プロセスの研究や光学装置の開発を行っている大学研究者・企業の方を講師としてお招きし、レーザー微細加工の最先端や、従来とは異なるユニークな加工の原理について解説いただきます。



13:30～13:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長 徳永 剛

13:35～14:20 **講演1**

「超短パルスレーザーによる微細構造形成技術」

株式会社リプス・ワークス 大竹 俊介 氏

14:20～15:05 **講演2**

「レーザー・マイクロ 3D プリンティングの進展」

横浜国立大学 丸尾 昭二 氏

15:05～15:20 ————— 休憩 —————

15:20～16:05 **講演3**

「フェムト秒レーザーパルス誘起光熱反応を利用した微細造形とデバイス応用」

長岡科学技術大学 溝尻 瑞枝 氏

16:05～16:50 **講演4**

「構造化された光 (Structured Light) を用いたレーザー加工技術」

千葉大学 尾松 孝茂 氏

16:50～17:00 **閉会挨拶**

レーザー協会副会長 比田井 洋史

【参加費】 会員：無料 非会員：7,000 円（銀行振込）

【申込方法】 レーザー協会第 203 回研究会申込フォーム

<https://forms.gle/sKGdptb382ty9zWM8> よりお申込みください

【参加申込〆切日】 2025 年 9 月 10 日（水）

【入金振込〆切日】 2025 年 9 月 16 日（火）

【問合先】 レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp

ウェブサイト <http://jslt.jp/>

